EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

07047197

PUBLICATION DATE

21-02-95

APPLICATION DATE

04-08-93

APPLICATION NUMBER

05193415

APPLICANT: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD;

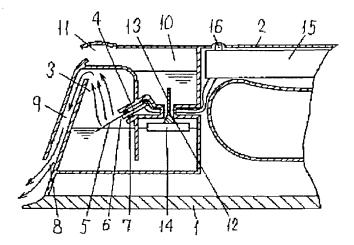
INVENTOR: OMICHI YUKINOBU;

INT.CL.

D06F 75/20 B06B 1/00 D06F 75/14

TITLE

: SPRAY TYPE IRON



ABSTRACT: PURPOSE: To provide a spray type iron which sprays a liquid evenly and without irregularities and does not cause inconvenience during ironing.

> CONSTITUTION: A perforated plate 5 vibrates by ultrasonic energy given by piezoelectric ceramic 4 composing an ultrasonic vibrator 6 provided in a steaming chamber 3 which communicates with a spray opening 8 made downward. Thus, a mist with small particle diameter can be emitted.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平7-47197

(43)公開日 平成7年(1995)2月21日

(51) Int.Cl.6

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

D06F 75/20

B 0 6 B 1/00

7627-5H

D06F 75/14

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特願平5-193415

(22)出願日

平成5年(1993)8月4日

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 日下 貴晶

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 大道 幸延

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

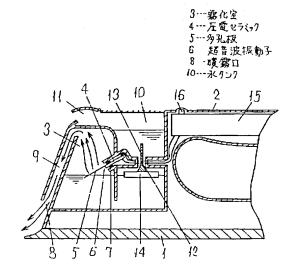
(74)代理人 弁理士 小鍜治 明 (外2名)

(54) 【発明の名称】 噴霧式アイロン

(57)【要約】

【目的】 均一でムラの無い噴霧を行なうと共に、アイロン掛け作業中に手を煩わすことの無い噴霧式アイロンを提供することを目的とする。

【構成】 下方に開口した噴霧口8に連通する霧化室3 内に設けた超音波振動子6を構成する圧電セラミック4 による超音波エネルギーによって、多孔板5が振動し、 粒径の小さい霧を放射できる噴霧式アイロンとするもの である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 下方に開口した噴霧口に連通する霧化室 と、この霧化室に水を供給する水タンクとを備え、前記 霧化室内に圧電セラミックと複数の穴を有する多孔板か らなる超音波振動子を設けた噴霧式アイロン。

【請求項2】 霧化室に代えて、水タンク内の水を吸い 上げる吸水体を備え、超音波振動子は多孔板が前記吸水 体に接するように配置した請求項1記載の噴霧式アイロ

た水タンク内の水を滴下するための滴下ノズルを備え、 超音波振動子は多孔板が前記滴下ノズルの下方となる位 置に配置した請求項1記載の噴霧式アイロン。

【請求項4】 滴下ノズルを複数とした請求項3記載の 噴霧式アイロン。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は一般家庭等において衣類 等のしわのばしを行なう噴霧式アイロンに関するもので ある。

[0002]

【従来の技術】アイロン掛けを効果的に行うための要素 には「温度」「水分」「加圧力」があり、この要素を満 たしたスチームアイロンの普及が高まっている。

【0003】しかしながらアイロン掛けをする衣類の材 質が、木綿・麻等の植物性繊維の場合には、スチームで は効果がなく、さらに多量の水分が要求されることから 噴霧式アイロンも普及してきている。この種の噴霧式ア イロンとしては、図9に示しているような構成のものが 一般的である。以下、その構成について図9を参照しな 30 がら説明する。

【0004】101は衣類を加圧・加熱してしわを伸ば したり折り目をつけたりするアイロンベースである。1 02はこのアイロンペース101の上面に装着した把手 であり、水タンク103を備えている。104は下部に 逆止弁105と噴水口106を有するシリンダーであ る。107は把手102の前壁を貫通して外方に突設し たノズルで、通水管108を介して噴水口106に接続 している。109はシリンダー104内に上下方向に摺 動自在に挿入したピストンである。ピストン109は、 その上端がシリンダー104の外方に突出しており、そ の上端には受板110を固定している。またこの受板1 10とシリンダー104間には、バネ111を縮設して いる。従ってピストン109は、常時上昇傾向に附勢さ れているものである。112は把手102の上部の透孔 113から自在に出没する押しポタンであり、その下面 はピストン109の上端に係接している。

【0005】以上の構成で、以下のように動作するもの である。使用者が把手102を握り親指で押しポタン1 12を押圧すると、ピストン109がパネ111に抗し 50 ンとするものである。

てシリンダー104内を下降する。ピストン109がシ リンダー104内を下降すると、シリンダー104内の 水は逆止弁105が閉じているため、噴水口106・通 水管108を経てノズル107より把手102の前方に 噴霧される。また、押しポタン112に対する押圧力を 取り除くと、ピストン109はパネ111による附勢力 を受けてシリンダー104内を上昇する。ピストン10 9がシリンダー104内を上昇すると、シリンダー10 4内は水タンク103内より負圧になるものである。こ 【請求項3】 霧化室に代えて、水タンクの下方に設け 10 のため水タンク103内の水は、逆止弁105を開いて シリンダー104内に吸い込まれる。水タンク103内 の水がシリンダー104を充満すると、逆止弁105を 再び閉塞する。この状態で再び押しボタン112を押圧 すると、前述と同様にしてシリンダー104内の水はノ ズル107から噴霧される。 このように押しポタン1 12に対する押圧力の附勢・解除を繰り返すことによっ て、シリンダー104とピストン109とがポンプ作用 を行ない、水タンク103内の水を噴霧するものであ る。

> 20 [0006]

> > 【発明が解決しようとする課題】しかしこのような構造 のものでは、ノズル107から噴霧される霧の粒径は1 00×10-3mm以上と非常に大きいものである。この ため、霧が噴霧された衣類の表面には水滴ムラができや すく、アイロン掛け作業後にシミが起こる原因となるも のである。また噴霧の際には、押しボタン112に対す る押圧力の附勢・解除を繰り返さなければならないた め、操作性が悪くなり指が疲れるという実用上の問題も 有している。

【0007】本発明はこのような従来の構成の噴霧式ア イロンが有している課題を解決しようとするものであっ て、均一でムラのない噴霧を行なうとともにアイロン掛 け作業中に手を煩わすことのない使い勝手のよい噴霧式 アイロンを提供することを第一の目的とするものであ る。また、前記第一の目的に加え噴霧機構を簡略化して 一層使い勝手のよい噴霧式アイロンを提供することを第 二の目的とするものである。また、前記第二の目的に加 え噴霧機構を一層簡略化して吸水体の交換等のメンテナ ンスが不要で手を煩わすことの無い噴霧式アイロンを提 40 供することを第三の目的とするものである。さらに前記 第三の目的に加え、一回のアイロン掛けで広範囲のしわ を伸ばすことのできる一層使い勝手のよい噴霧式アイロ ンを提供することを第四の目的とするものである。

[0008]

【課題を解決するための手段】第一の目的を達成するた めの本発明の第一の手段は、下方に開口した噴霧口に連 通する霧化室と、この霧化室に水を供給する水タンクと を備え、前記霧化室内に圧電セラミックと複数の穴を有 する多孔板からなる超音波振動子を設けた噴霧式アイロ

【0009】また第二の目的を達成するための本発明の 第二の手段は、前記本発明の第一の手段を構成する霧化 室に代えて、水タンク内の水を吸い上げる吸水体を備 え、超音波振動子は多孔板が前記吸水体に接するように 配置した噴霧式アイロンとするものである。

【0010】また第三の目的を達成するための本発明の 第三の手段は、前記本発明の第一の手段を構成する霧化 室に代えて、水タンクの下方に設けた水タンク内の水を 滴下するための滴下ノズルを備え、超音波振動子は多孔 アイロンとするものである。

【0011】また第四の目的を達成するための本発明の 第四の手段は、前記本発明の第三の手段を構成する滴下 ノズルを複数とした噴霧式アイロンとするものである。

[0012]

【作用】本発明の第一の手段は、霧化室内の水を超音波 振動子の音波エネルギーで噴霧させることにより霧の粒 径を微細化し、均一でムラの無い噴霧を行なうことがで きるものであり、超音波振動子による連続噴霧により作 ロンを実現するものである。

【0013】また本発明の第二の手段は、水タンク内か ら吸い上げた吸水体中の水分を超音波振動子の音波エネ ルギーにより噴霧させる構成とすることによって噴霧機 構を大幅に簡略化した、軽量・安価で使い勝手のよい噴 霧式アイロンを実現するものである。

【0014】また本発明の第三の手段は、滴下ノズルか ら多孔板上に滴下した水滴を超音波振動子のエネルギー によって噴霧する構成とすることによって、噴霧機構を 一層簡略化し、吸水体の交換等のメンテナンスも不要で 30 使い勝手のよい噴霧式アイロンを実現するものである。

【0015】さらに本発明の第四の手段は、複数の滴下 ノズルを使用して多孔板上に滴下した広範囲の水滴によ って噴霧面積を増大させ、一回のアイロン掛けで広範囲 のしわを伸ばすことのできる一層使い勝手のよい噴霧式 アイロンを実現するものである。

[0016]

【実施例】

(実施例1)以下本発明の第一の手段の実施例を、図1 に基づいて説明する。1はアイロンベース、2はこのア 40 イロンベース1の上面に装着した把手であり、3は把手 2の前部に設けた霧化室である。この霧化室3内には超 音波振動子6を設けており、この超音波振動子6は圧電 セラミック4に複数の約10~50μmの穴を有する多 **孔板5を接着した構成となっている。7はこの超音波振** 動子6と霧化室3の間を液密に支持するパッキンであ る。8は噴霧口であり、霧通路9を介して霧化室3に連 通している。10は把手2の上方前部に位置させた水夕 ンクで、上部には給水口11を有し、底部には霧化室3

12を開閉するための開閉弁であり、霧化室3内のフロ ート14上に設けている。15は前記圧電セラミック4 を振動させるための回路であり、16は圧電セラミック 4の振動をON・OFFするためのスイッチである。

【0017】以下、本実施例の動作を図1・図2に基づ いて説明する。給水口11から水タンク10内に供給さ れた水は、滴下口12より霧化室3へと流入する。霧化 室3内のフロート14は、霧化室3に流入した水の水面 の高さに応じて上昇してゆき、開閉弁13はこのフロー 板が前記滴下ノズルの下方となる位置に配置した噴霧式 10 ト14によって上方に押し上げられる。 霧化室3内の水 面が超音波振動子6の噴霧に必要な高さにまで到達する と、滴下口12は開閉弁14により下方からふさがれ て、水タンク10から霧化室3への水の流入は停止する こととなる。

【0018】スイッチ16を押すと、回路15は高い周 波数のパルスを超音波振動子6を構成する圧電セラミッ ク4に与える。圧電セラミック4はこのパルスを受け て、高周波で振動し音波を発生する。この音波エネルギ ーによって、圧電セラミック4を取り付けている多孔板 業者の手を煩わすことのない使い勝手のよい噴霧式アイ 20 5が振動する。このようにして超音波振動子6は髙周波 の音波エネルギーを発生するものである。 霧化室 3内の 水は、多孔板5の先端近傍の下方から約10~50μm の穴を通過して上方に霧となって噴霧される。この霧 は、霧通路9を経て噴霧口8より把手2の前方に噴霧さ れる。

> 【0019】なお、霧の噴霧によって霧化室3内の水面 が下降すると、フロート14及び開閉弁13がそれにと もなって下降し、滴下口12より水タンク10の水が供 給され霧化室3内の水面は常に噴霧に適当な高さに保た れるようになっている。

> 【0020】ところで、超音波振動子6によって噴霧さ れた霧の径は約10~50 µmと非常に細かく衣類の折 り目の細部にまで入り込むものである。このため、噴霧 状態は均一となって、衣類上に水滴ムラを生ずるような ことはなく、シミの残らない均一な仕上がり効果を得る ことができる。この効果は、パキュームファンを内設し 衣類の載置面から空気を吸引することのできるバキュー ムアイロン台を併用することによって、より一層高めら れることが実験により明かになっている。

【0021】また、もしスイッチ16を一度押せば保持 できる回路としておけば、スイッチ16から手を離して いても連続した噴霧が得られ楽にアイロン掛けができる ものである。

【0022】なお噴霧方向を図1に示すように前方とす る場合は、広い面積について仕上げるときに適当であ り、また図2に示すようにアイロン掛け面とする場合 は、部分的に水分を多く必要とする仕上げのときに適当 である。

【0023】 (実施例2) 次に、本発明の第二の手段の に連通する滴下口12を有している。13はこの滴下口 50 実施例を図3に基づいて説明する。1はアイロンベー

ス、2はこのアイロンベース1の上面に装着する把手で ある。6は把手2の上方前部に設けた超音波振動子であ り、この超音波振動子6は圧電セラミック4に複数の約 10~50μmの穴を有する多孔板5を接着した構成と なっている。7は超音波振動子6と把手2の間を液密に 支持するパッキンである。10は把手2の前部に設けた 水タンクであり、上部には給水口11を有している。1 5 は超音波振動子 6 を振動させるための回路であり、1 6は超音波振動子6の振動をON・OFFするためのス イッチである。17はこの水タンク10内の水を吸い上 10 げるフェルト等によって構成した吸水体である。この吸 水体17は、この多孔板5の噴霧面とは反対側の面に接 触するように、ピン18で把手2に固定されている。

【0024】以下、本実施例の動作を図3・図4に基づ いて説明する。給水口11から水タンク10内に供給さ れた水は、吸水体17により吸い上げられている。この 状態でスイッチ16を押すと、回路15は高い周波数の パルスを超音波振動子6を構成している圧電セラミック 4に与える。圧電セラミック4はこの振動数で振動し、 音波を発生する。この音波エネルギーによって多孔板5 が振動し、吸水体17中の水分は多孔板5の噴霧面とは 反対側の面から約10~50μmの穴を通過して、把手 2の前方に噴霧される。

【0025】ところでこの噴霧式アイロンは、水タンク 10内の水を吸水体17により吸い上げ、この吸水体1 7中の水分を超音波振動子6によって霧化し噴霧する方 式を取っており、本発明の第一の手段の実施例と同様の 効果が得られるうえに、水面の高さを一定化する機構が 不要となるものである。このため、軽量かつ安価になる という利点も有している。

【0026】噴霧方向を図3に示しているように前方と する場合は、広い面積について仕上げるときに適当であ り、また図4に示しているようにアイロン掛け面とする 場合は、部分的に水分を多く必要とする仕上げのときに 商当である。

【0027】 (実施例3) 次に、本発明の第三の手段の 実施例を図5に基づいて説明する。前記実施例と同様の 部材については、同様の番号を付して以下の説明を省略 する。圧電セラミック4に複数の約10~50μmの穴 を有する多孔板5を接着した構成の超音波振動子6は、 その多孔板5が水タンク10内の水を滴下する滴下ノズ ル19の真下にくるように把手2に固定されている。な お、20は水タンク10内の水を滴下ノズル19に導く ための導水路であり、21は導水路20の入り口の開閉 を行う電磁弁である。この電磁弁21は、超音波振動子 6の振動がONした時に開くように回路15内で設定さ れている。

【0028】以下、図5・図6に基づいて本実施例の動 作を説明する。スイッチ16を押すと、回路15は高い 周波数のパルスを超音波振動子6を構成する圧電セラミ 50 する場合は、部分的に水分を多く必要とする仕上げのと

ック4に与える。圧電セラミック4はこの振動数で振動 して音波を発生し、この音波エネルギーによって多孔板 5が振動する。またこの時電磁弁21が開いているた め、水タンク10内の水は電磁弁21・導水路20を終 て滴下ノズル5から多孔板5上に滴下されている。滴下 された液滴は、多孔板5の噴霧面とは反対側の面から約 10~50μmの穴を通過して把手2の前方に噴霧され る.

【0029】ところで、この噴霧式アイロンは水タンク 10内の水を滴下ノズル19により滴下し、超音波振動 子6によって噴霧する方式を取っており、本発明の第一 の手段の実施例と同様の効果が得られるうえに、水面の 高さを一定化する機構が不要となるため、軽量かつ安価 になるという利点も有している。また吸水体を使う必要 もないため、吸水体の交換等のメンテナンスも不要とな り、作業者の手を煩わすことのない使い勝手のよい噴霧 式アイロンとなる。

【0030】なお噴霧方向を図5に示すように前方とす る場合は、広い面積について仕上げるときに適当であ り、図6に示すようにアイロン掛け面とする場合は部分 的に水分を多く必要とする仕上げのときに適当である。

【0031】(実施例4)次に本発明の第三の手段の実 施例を図7に基づいて説明する。前記実施例と同様の部 材については、同様の番号を付して以下の説明を省略す る。22は水タンク10内の水を滴下するための滴下ノ ズルである。そして超音波振動子6は、多孔板5が前記 滴下ノズル22の真下にくるように把手2に固定されて いる。なお本実施例においては、滴下ノズル22は多孔 板5の噴霧面からはみ出さない範囲で複数個設けてい る.

【0032】以下、図7・図8に基づいて本実施例の動 作を説明する。スイッチ16を押すと、回路15は高い 周波数のパルスを圧電セラミック4に与える。そして圧 電セラミック4はこの振動数で振動し音波を発生し、こ の音波エネルギーにより多孔板5が振動する。またこの 時電磁弁21は開いているため、水タンク10内の水は 電磁弁21、導水路20を経て滴下ノズル22から多孔 板5上に滴下される。そしてこの滴下された液滴は多孔 板5の噴霧面とは反対側の面から約10~50 µmの穴 を通過して把手2の前方の所定物に噴霧される。

【0033】ところで、この噴霧式アイロンは水タンク 10内の水を複数の滴下ノズル22により滴下し、超音 波振動子6によって噴霧する方式を採っている。このた め噴霧面積を増大させることが可能で、一回のアイロン 掛けで広範囲のしわを伸ばすことのできる使い勝手のよ い噴霧式アイロンとなるものである。

【0034】なお噴霧方向を図7に示しているように前 方としている場合は、広い面積について仕上げるときに 適当であり、図8に示しているようにアイロン掛け面と

.30

7

きに適当である。

【0035】なお実施例3および実施例4においては、 滴下ノズル19・22の開閉は電磁弁21を用いている が、例えば滴ドノズルに開閉用の針を設け超音波振動子 のON・OFFに応じて上下するような機構としてもよ いことは明かである。

[0036]

【発明の効果】本発明の第一の手段は、下方に開口した 噴霧口に連通する霧化室と、この霧化室に水を供給する 水タンクとを備え、前記霧化室内に圧電セラミックと複 10 数の穴を有する多れ板からなる超音波振動子を設けた構成として、アイロン掛けを容易にし、均一でムラの無い 噴霧を行うことができる噴霧式アイロンを実現するもの である。

【0037】また本発明の第二の手段は、本発明の第一の手段を構成する霧化室に代えて、水タンク内の水を吸い上げる吸水体を備え、超音波振動子は多孔板が前記吸水体に接するように配置した構成として、本発明の第一の手段の効果に加えて噴霧機構を大幅に簡略化し、軽量かつ安価な噴霧式アイロンを実現するものである。

【0038】本発明の第三の手段は、同様に霧化室に代えて、水タンクの下方に設けた水タンク内の水を滴下するための滴下ノズルを備え、超音波振動子は多孔板が前記滴下ノズルの下方となる位置に配置した構成として、噴霧機構を一層簡略化し、吸水体の交換等のメンテナンスも不要で使い勝手のよい噴霧式アイロンを実現するものである。

【0039】さらに本発明の第四の手段は、本発明の第三の手段を構成する滴下ノズルを複数として、噴霧面積を増大させ一回のアイロン掛けで広範囲のしわを伸ばす

ことのできる一層使い勝手のよい噴霧式アイロンを実現 するものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第一の手段の第一の実施例における噴霧式アイロンの縦断面図

【図2】同第二の実施例における噴霧式アイロンの縦断 面図

【図3】本発明の第二の手段の第一の実施例における噴霧式アイロンの縦断面図

7 【図4】同第二の実施例における噴霧式アイロンの縦断 面図

【図5】本発明の第三の手段の第一の実施例における噴 霧式アイロンの縦断面図

【図 6】 同第二の実施例における噴霧式アイロンの縦断面図

【図7】本発明の第四の手段の第一の実施例における噴霧式アイロンの縦断面図

【図8】同第二の実施例における噴霧式アイロンの縦断 面図

20 【図9】従来の噴霧式アイロンの縦断面図 【符号の説明】

3 霧化室

4 圧電セラミック

5 多孔板

6 超音波振動子

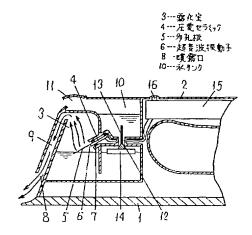
8 噴霧口

10 水タンク

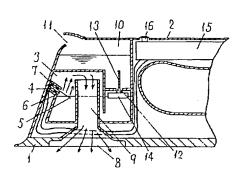
17 吸水体

19・22 滴下ノズル

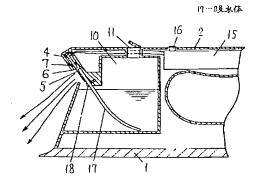
【図1】



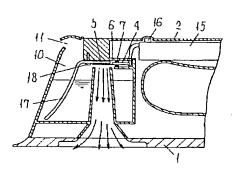
[図2]



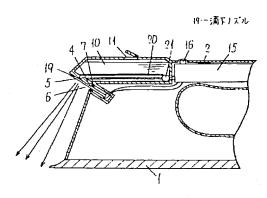




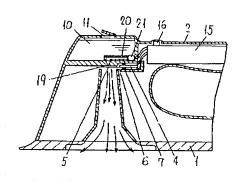
[図4]



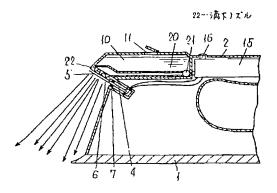
[図5]



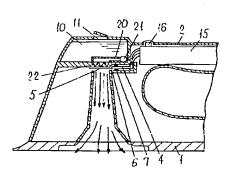
[図6]



[図7]



[図8]



【図9】

